文章编号: 1001-3806(2005)03-0325-03

# Otto结构表面等离子体波光调制器模拟计算

胡远,朱晓\*,齐丽君

(华中科技大学 激光技术国家重点实验室, 武汉 430074)

摘要:根据受抑全内反射(FTR)光调制器的原型,结合金属表面受激所产生的表面等离子体波(SPW)与 p 偏振光 共振并吸收光能量的性质,设计了 O tto结构的 SPW 光调制器,通过改变 O tto结构中空气间隙的大小或入射角的大小这 两种方式对入射光进行调制。针对 Cu A J A g 3种金属以及 1.064<sup>µ</sup>m 和 0.532<sup>µ</sup>m 两种波长激光的情况下进行了模拟计 算。结果表明,改变入射角方式的调制效果更佳,0.5°的入射角改变所引起的反射率 R 的变化量可达 0.9以上。

关键词:光调制器;表面等离子体波;Otto结构;受抑全内反射

中图分类号: 053 文献标识码: A

Numerical simulation of Otto structure in surface plasma wave lightmodulator

H U M in ¬yua n, ZH U X iao, Q I L i-jun

(National Laboratory of Laser Technology, HUST, Wuhan 430074, Christian 12, 20074, Christian

Abstract On the foundation of fustrated total internal reflection (FTR) light modulator combining the character of surface plasma wave (SPW) which is excitated on the surface of metal and can be resonant with p polarization light and absorbs its energy, amodified type SPW light modulator of O to structure is designed in O to structure, the reflectivity can be modulated by changing thickness of air gap or the angle of incidence. The numerical simulation is made in the situation of three k inds of metal Cu, Al Ag and two wavelengths 1 064<sup>µ</sup>m, 0 532<sup>µ</sup>m, and the results show that modulate effect of the method of changing angle of incidence is better 0.5° of the angle change can result in reflectivity's variety value is above 0.9.

Key words light modulator, surface plasm a wave (SPW). Otto structure, fustrated total internal reflection (FTR)

## 引 言

受抑全内反射 (FT R)光调制器是一种低损耗、高效率的新型光调制设备;它克服了许多传统调制方式的缺点,如调制深度不够、不稳定、脉冲的峰值功率不高和脉宽不够窄等。

FT R 光调制器是由两块平行相对的石英棱镜组 成,通过压电换能器迅速改变两棱镜间的空气间隙来 改变反射率,从而改变腔内的损耗来对入射光进行调 制<sup>[1]</sup>。

通过计算可知, FT R 光调制器要求两块棱镜间的 空气间隙厚度为入射波长的 0 05倍~0 1倍时才能 达到理想的调制深度,而在实际工艺中这一点很难实 现。表面等离子体波(SPW)光调制器的出现正是为 了解决这个问题。

1 SPW 波的原理及 SPW 光调制器模型

金属中除了有束缚电子外,还包含着大量的自由

作者简介: 胡 远 (1980-), 男, 硕士研究生, 主要从事固体激光器的研究与设计。

\* 通讯联系人。 E-mail zx@ mail hust edu cn 收稿日期: 2004-04-27 电子,这些自由电子在电场作用下能在金属中移动。 金属或半导体的表面电子的行为类似于自由电子气, 表面等离激元(surface plasmons SP)就存在于其表面。 其被边界上的外来电场激发后产生表面自由电荷的集 体振荡,即表面等离激元振荡(surface plasmon oscillations, SPO)。这种振荡相当于一种在界面传播的波, 也称为表面等离子体波(surface plasmon wave, SPW)。 SPW 沿表面或者界面传播,其振幅随离开界面的距离 而指数衰减<sup>[2]</sup>。因此, SPW 仅局限在表面或界面的有 限距离(波长数量级)之内。 SPW 不能与平面电磁波 直接耦合。KRET SCHMANN 与 OTTO 先后提出了两 种可以实现耦合的方法(见图 1和图 2)。即通过光波 由光密媒质到光疏媒质发生全反射时产生的迅衰波 (evanescentwave, EW)与 SPW 共振耦合。其中,



Fig 1 Kretschmann structure

潡



Fig 2 Otto structure

K retsdm ann结构是按棱镜、金属、空气的顺序,金属的 厚度约为几十纳米。让 p偏振的激光以特定的角度从 玻璃内部入射,通过倏逝波场耦合到金属膜和介质的 表面,激发 SPW,此时入射光的能量发生共振转移,反 射光强会相应减弱,这个角度称为共振角。Otto结构 与 K retschm ann结构的不同在于它是按棱镜、空气、金 属的顺序,金属层的厚度只要大于微米量级 (可认为 无限厚)都可以满足要求<sup>[3,4]</sup>。

共振指的是当振动系统受被迫振动,所加外力的 频率与其固有频率接近或相等时,合振幅急剧增大或 减小的现象。因此,可以理解为:表面等离子波就是在 金属界面上的自由电子被边界上的外来电场激发后引 起的表面电荷的量子振动。这里是由激光引起的。由 于界面上材料、入射角度的不同,所引起的 SFW 波的 波矢也不同,当在材料一定的情况下,入射角达到某一 特定值的时候, SFW 波的波矢与激光的波矢在界面上 的水平分量 (*p*分量)一致时,就会发生共振现象,入射 光的能量发生共振转移,反射光强会相应减弱和增强, 即是对 *r*的调制。

使用菲涅耳公式和单层膜的反射率计算公式,可 算得反射系数 r(其中金属的介电常数为复数):

 $r = (r_{01} + r_{12} e^{2ik_{1z}d}) / (1)$ 

其中:

$$x_{j,j+1} = (x_j - x_{j+1})/(x_j + x_{j+1}) \quad (j = 0, 1) \quad (2)$$

$$x_j = \varepsilon_j / k_{jz} \quad (j = 0, 1, 2)$$
 (3)

$$k_{jz} = \sqrt{(\omega/c)^2 \epsilon_j - k_{0x}^2} \quad (j = 0, 1, 2) \quad (4)$$

 $k_{0c} = (\omega/c) \sqrt{\epsilon_0} \sin\theta$  (5) 式中, r为 p偏振状态下的值,  $\epsilon_0 \epsilon_k \epsilon_2$ 分别为玻璃、金 属、介质的介电常数,  $\omega$ 代表光波频率, c为光在真空中 的传播速度, d为金属膜厚。等离子体波的波矢为<sup>[5]</sup>:  $k_{sP} = (2\pi/\lambda) \sqrt{\epsilon_0 \epsilon_1/(\epsilon_0 + \epsilon_1)}$  (6) 当  $k_{sP} = k_0$ 的时候,产生等离子体波共振,于是该波长的 p 偏振态光的能量产生极大的衰减。 r也会产生相应的变化,即 r也就得到调制。

考虑到棱镜和较薄的金属薄膜不能承受过高的功 率密度,并且加工难度较大,因此用 Otto结构来做 SPW 光调制器的设计是较为合适的。下面的模拟计 算也就是基于 Otto结构的。

2 Otto结构中的模拟计算

2.1 计算模型的建立

激光的振荡条件为:

$$Y(t) = \alpha L = Y_0 - \ln R \tag{7}$$

式中,  $Y_0$ 为常数, t为时间, L代表腔长,  $\alpha$ 代表增益系数。在这里, 反射率 R 是指把整个结构看作为一个整体的反射率, 它是一个决定性的变量。

由薄膜光学理论,单层介质薄膜的特征矩阵为:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{R}_{1} & \mathbf{R}_{2} \\ \mathbf{R}_{1} & \mathbf{S} & \mathbf{I} \\ \mathbf{R}_{2} & \mathbf{S} \\ \mathbf{R}_{3} & \mathbf{S} \\ \mathbf{R}_{4} & \mathbf{S} \\ \mathbf{R}_{3} & \mathbf{S} \\ \mathbf{R}_{4} & \mathbf{S} \\ \mathbf{R}_{4} & \mathbf{R}_{4} \\ \mathbf{R}_{4} & \mathbf$$

式中, 6代表反射和透射形成的位相差, 且:

$$\delta_{1} = (2\pi/\lambda)N_{1}d_{1}\cos\theta_{1} \qquad (9)$$

$$p$$
分量有  $\eta_1 = N_1 / \cos \theta_1$  (10)

$$\mathbf{E}\mathbf{K}\begin{bmatrix}B\\C\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\cos\delta_{1} & \sin\delta_{1}/\eta_{1}\\\eta_{1}\sin\delta_{1} & \cos\delta_{1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\\eta_{2}\end{bmatrix}$$
(11)

定义为基片和薄膜组合的特征矩阵,则组合导纳:

$$W = C /B = \frac{\eta_2 \cos \delta_1 + \eta_1 \sin \delta_1}{\cos \delta_1 + i(\eta_2 / \eta_1) \sin \delta_1}$$
(12)

故振幅反射系数为:  $r = \frac{\eta_0 - Y}{\eta_0 + Y}$  (13)

相应的反射率为:  $R = r \cdot r = \left| \frac{\eta_0 - Y}{\eta_0 + Y} \right|^2$  (14)

(9)式~(14)式中, 下标 0代表玻璃, 1代表空气, 2代 表金属; λ为真空中入射光波长,  $d_1$ 为空气间隙厚度,  $\theta_0$ 为入射角,  $\theta_i$ 为折射角;  $\theta_2$ 由折射定律导出, 为复 数;  $N_i$  (*j*= 0, 1, 2)为复折射率,  $\eta_i$ 为有效导纳<sup>[6]</sup>。

选用比较常见的几种金属,如: Cu, Al Ag在波长 分别为 1.064<sup>µ</sup>m 和 0.532<sup>µ</sup>m 的激光下,其复折射率 的值由表 1所示。

Table 1 Re	fractive	index	of Cu,	A,l Ag
------------	----------	-------	--------	--------

(1)

w av e kngth /µm		m aterial	
	Cu	A l	Ag
1. 064	0. 364188- 7. 146813	1. 21- i10 6	0 235375 - 17. 31375
0. 532	1. 092437- 2 595562	0.867-i6 42	0 130063 - B. 159375

将表 1中的数据代入(7)式~(13)式,可用数学计算

工具算出相应的最低反射率,及此时的最佳间隙距离

## 和入射角,如表 2表 3表 4所示。

13	able 2 Minmum	reflectivity index		
wavelength /µm	m aterial			
	Cu	Al	Ag	
1 064	4. 8991×10 <sup>-5</sup>	7. 7439×10 <sup>-5</sup>	4 2583 × 10 <sup>−</sup>	
0 532	0 086873	0. 28481	0 77881	
Table 3	Optinum airga	p's distance index	/m	
wavelength /µm		material		
	Cu	Al	Ag	
1 064	1. 81 × 10 <sup>-6</sup>	1. 95× 10 <sup>-6</sup>	$2 06 \times 10^{-6}$	
0 532	2. 98× 10 <sup>-6</sup>	3× 10 <sup>-6</sup>	2 97 × 10 <sup>-6</sup>	
Table 4	Optimum angle of incidence index /( $^{\circ}$ )			
wavelength /µm	material			
	Cu	Al	Ag	
1 064	43. 73	43. 38	43 74	
0 532	43. 04	42.99	43 03	

#### 2 2 固定间隙距离方案的计算结果

考虑到反射率 *R* 只与间隙距离 *d* 和入射角有关, 所以固定间隙距离而改变入射角是一种改变 *R* 的方 式。这里的 *d* 值取为各金属的最佳间隙距离。

由图 3和图 4可知,在波长为 1.064<sup>µ</sup>m 下,各金





Fig 4 Relationship between reflectivity and angle of incidence in wavelength of 1. 064<sup>11</sup>m

属入射角 θ在 43°~44°之间改变 0 5°时, *R* 的变化可 以达到 0.9以上。而在波长为 0.532μm 下, θ在 42°~44°之间改变 0 5°时, 各金属的 *R* 的变化相差则 较大, 其中 Cu有 0 6 A l有 0 4 Ag只有 0 2 在长波 长的情况下, 各金属的反射率 *R* 都会在某一特定角处 变化非常快, 很适合调制过程的需要, 而在短波长的情 况下,这样的现象就不再显著。

2 3 固定入射角方案的计算结果

固定入射角度而改变间隙距离是另外一种改变 *R* 的方式,这里的入射角取值为最佳入射角度。

从图 5和图 6 同样可以看出在波长为 1.064<sup>µ</sup>m



Fig 5 Relationship between reflectivity and air gap distance in wavelength of 0.53214 m



6 Relationship between reflectivity and air gap distance in wavelength of 1.064<sup>µ</sup>m

下, 各金属的 d在 2<sup>µm</sup> 左右改变 0. 5<sup>µm</sup> 时, R的变化 可以达到 0.5左右。而在波长为 0.532<sup>µm</sup> 下, 同样 的, 各金属的情况就有了区别, d在 0.5<sup>µm</sup>~ 1<sup>µm</sup>之间 改变 0.5<sup>µm</sup>时, R的变化: Cu 有 0.6, A l有 0.5, AgQ 为 0.1。并且这样的现象在 3<sup>µm</sup> 处会再度出现, 把调 制区域取在此处可以完全伸展开来, 不受距离限制。 因此, 在长波长的情况下各金属的反射率 R 变化趋势 差别不大, 而在短波长下则因金属的不同而相差较大, 只有合适的金属 (如 A1 Cu)才有较好的效果。

因此,总的来说还是长波长下各金属 *R* 的变化更适合调制过程的需要。

## 3 结 论

分析了金属表面所产生的 SPW 波产生的原理及 特性,并运用薄膜光学中的理论对 SPW 光调制器中棱 镜与金属薄膜所组成的整体的反射率 R 进行了数值 模拟。可以看出,不论是固定间隙距离而改变入射角 的方式还是固定入射角而改变间隙距离的方式,都可 以找到特定的调制区域,在此处 R 的变化非常大,适 合调 Q 过程的需要,是比 FT R 调制深度更大的一种 光调制器。并且在长波长的激光器中应用前景更大。

(下转第 331页)

23 数据处理

将测出的全部数据分别在 x 方向和 y 方向求出其 均方根,所得的数据即为星光 子束角漂的结果,其具 体数值如下。

 $\sigma_x = 9$  3 $\mu$ m, 将其转换为角度:

9 3 × 
$$\frac{1}{4 84 \times 2}$$
 = 0 96" (2)

 $\sigma_y = 11.8 \mu m$ ,将其转换为角度:

$$11 \ 8 \times \frac{1}{4 \ 84 \times 2} = 1 \ 22'' \tag{3}$$

则在径向方向上总的角漂为:

$$\sqrt{0.96^2 + 1.22^2} = 1.55'' \tag{4}$$

3 讨 论

以上只是从理想的角度,对测量数据进行分析得 出的结论。然而事实上,在测量过程中,存在着很多不 确定的因素,包括人为主观上的判读误差和步进电机 本身的定位误差,以及激光器所处外在环境的不稳定, 都会给最后的测量结果带来较大的影响,测量中的误 差主要包含以下方面。

31 人眼读数误差

由整个测量系统的放大倍数可知,监视器屏幕上 lmm的位移量相当于实际小孔 1/900~ 1µm 的位移 量。而人眼对于监视器上低于 3mm 的位移量变化已 经不能很明确的判断了,所以,人眼对于小孔位移量的 判断误差为: 3/900~ 3µm。

### 3 2 步进电机的行程精度

为消除步进电机的回空差,在每一发测量 x, y方向的偏移量时,只让电机在 z y方向企朝一个方向步进,避免了来回步进所带来的回空差。而电机的步进 定位误差远小于 1<sup>µ</sup>m,相对于此次角漂测量来说,可 忽略不计。

3 3 外界环境的影响

本次测量的 5d时间中,每发打孔之前都观测前一 发在铝镜上打出的小孔在监视器上图像的位移变化, 结果发现,每两发次之间因测量平台结构晃动造成的 焦斑位移量最大不超过 3mm;以每天测量的最后一发

(上接第 327页)

#### 参考文献

- [1] 张镇西,张智勇,程向明. FTR光调制器的理论探讨 [J]. 光学学 报, 1984 4(5): 450~ 455.
- [2] 高治文, 陈丽娜, 赵景星 et al. 表面等离激元共振 [J]. 大学物理实 验, 1994, 7(2): 1~4
- [3] KRETSCHMANNE, RAETHERH. Radiative decay of non-radiative surface plasmons excited by light [J]. Z Naturforsch 1968, A23: 2135

图像在监视器上的位置为基准,参考第2天这一图像 的位置,结果发现,因外部环境的不稳定造成的图像位 移量平均为4mm,综合上述观察结果,可将外界环境 对于测量结果造成的误差归结为4/900≈44m。为尽 量减少由于周围环境的振动造成测量平台与激光装置 发生相对位移,在每天的数据测量过程中,都是以当天 的第1发为基准,所以前面分析出的测量结果,反映出 的是星光 子束在每一天当中的平均角漂量,即激光 器自身固有的漂移量;若要从客观实际的角度反应星 光 激光装置在一段时间的总体角漂量,则需要另外 加上人眼的读数误差和随着时间推移测量平台的不稳 定即受到外界环境的影响所带来的漂移量。因此测量 结果的不确定因子:

$$\Delta = (4+3) \times \frac{1}{4\ 84 \times 2} = 0\ 72'' \qquad (5)$$
  
因而最终的实验结论应为,  $1\ 55'' \pm 0.\ 72''_{\circ}$ 

4 结 论

此次实验研究的目的在于验证星光 激光装置子 束光路的发射角度稳定性,从而考核其能否精确定位 于靶点,达到测量等离子体电子温度和电子密度的目 的。按照星光 激光装置的运行要求,确定其打靶光 路的角漂范围不得大于 2<sup>°</sup>,此次实验的结果充分说 明,该装置在光束指向性这一指标上,是完全满足实验 要求的。而且该实验本身,也给激光角漂的测量这一 类问题提供了一定的参考依据。

在此对中物院激光聚变研究中心王文义同志的大 力协助表示感谢!

#### 参考文献

- [1] 景 峰, 彭志涛, 朱启华 et al 高功率固体激光器的优化设计 [J]. 强激光与粒子束, 2000, 12(sl): 117~121
- [2] 彭能岭,李文洪,江少恩 et al. 等离子体电子密度诊断的全息干涉法
  [J]. 强激光与粒子束, 2002, 14(2): 254~256
- [3] 王成程,陈清海,邓 武 et al. 用于 ICF基准物理实验的子束激光 系统优化设计 [J]. 光学与光电技术, 2003, 5: 35~ 38
- [4] 师智全,魏晓峰,马 驰 et al. 大型固体激光器光束定位稳定性分析
  [J]. 强激光与粒子束, 2000, 12(sl): 167~170.
- [5] 同济大学数学教研室. 工程数学 概率 论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1982 75~76

~ 2136.

- [4] RAETHER H. Surface plasma oscillations and their applications [A]. Physics of Thin Films [C]. New York: A cadem ic Press, 1977. 145 ~ 261
- [5] CULSHAW B, DAK N J 光纤传感器 [M]. 武汉: 华中理工大学出版 社, 1997. 203
- [6] 唐晋发,顾培夫.薄膜光学与技术 [M].北京:机械工业出版社, 1987.13~29